

磁場中熱処理装置

全景



【装置の基本仕様】

- ・最高温度：500℃
- ・最大磁場：0.3 T(テスラ)
- ・雰囲気：①真空(10⁻⁴Pa台)
②ガス置換(ガス種は要相談)

【磁場の方向制御仕様】

- ・回転速度：10～30rpm
- ・静止角度精度：±0.5° (任意角度)
- ・動作モード：熱処理中に回転/静止の切替えが可能(プログラム制御)

【その他】

- ・サンプルホルダ形状：
□26mm-t1mmの基板が5枚セット可能な溝挿入式
- ・温度均一度：試料領域で±5℃以内
- ・磁場均一度：試料領域で±5%以内

機種名

東栄科学産業 TKSRMAO-25305
2017年度購入

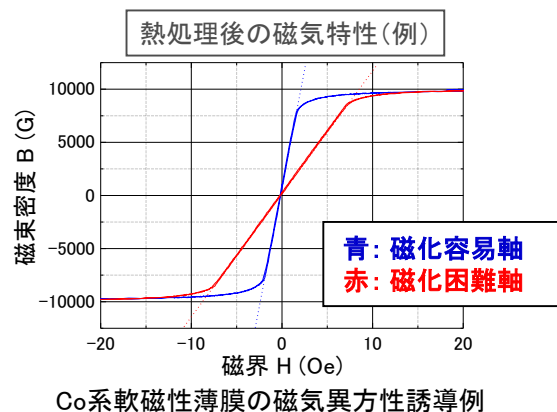
特徴

磁場中熱処理装置は、物質材料を磁場中で熱処理する装置です。磁場の印加により、材料中の磁化の向きや強さ(磁気異方性)を制御したり、内部構造の配向を制御することが可能です。本装置を用いて、新しい磁性材料の開発や探索が可能になります。

●用途

磁場をかけながらの熱処理

- ・静磁場中熱処理
(任意角度の磁場印加が可能)
- ・回転磁場中熱処理



料金等

機器使用： 1,300 円 / 時間

操作法説明： 3,900 円 / 時間
(説明には、2時間程度かかります)

本装置は、クリーンルームに設置されているため、クリーンルーム使用料2,000円/時間が別途かかります。

研究員による支援

3,900 円 / 時 + 機器使用料等

サンプル洗浄等前処理

<実施例>

- ・溶剤洗浄
 - ・純水洗浄
- (いずれも、クリーンルーム内での超音波洗浄が可能)